

Publikationsliste Marc Sandner (ms@saphmar.net)

Stand 01.01.2016

Zeitschrift (begutachtet)

Sandner, M.; Kolenović, E.; Klattenhoff, R.; Kolenović, E.; Elandalousi, F.; v. Kopylow, C.; Bergmann, R. B.: *Axially distributed sensing with a monoscopic imaging lens for single-shot distance measurements*. Applied Optics 53/22 (2014), S. 5078 – 5083

Sandner, M.; Burke, J.; v. Kopylow, C.; Bergmann, R. B.: *Messen und Prüfen mit Licht*. Werkstattstechnik online, 11/12 (2012), S. 777-782

Zeitschrift (nicht begutachtet)

Woizeschke, P.; **Sandner, M.**: *Verzugsmessung beim Lasermikroschweißen*. Mikroproduktion (Spezial zur Mikrolaserbearbeitung) 3/14 (2014), S. 42-43

Proceedings

Sandner, M.: *Hybrid Reflectometry - 3D shape measurement on scattering and reflective surfaces*. 115. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für angewandte Optik (DGaO 2014), B29
(online: http://dgao-proceedings.de/download/115/115_b29.pdf)

Sandner, M.; Li, W.; Burke, J.: *Sub- μm genaue Formmessung spiegelnder Oberflächen mittels Deflektometrie*. Photogrammetrie dLaserscanning Optische 3D-Messtechnik - Beiträge der Oldenburger 3D-Tage 2013, eds.: T. Luhmann, C. Müller. Wichmann Berlin (2013), S. 208-216

Sandner, M.; Falldorf, C.; Simic, A.; Burke, J.; Bergmann, R. B.: *Areal absolute form measurement of optical surfaces using Phase Measuring Deflectometry and Shearing Interferometry*. Proc. 6th High Level Expert Meeting on Asphere Metrology, Braunschweig (2013) (CD)

Li, W. ; **Sandner, M.** ; Burke, J.: *Simulation study of deflectometry systems*. 114. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für angewandte Optik (DGaO 2013), A1
(online: http://dgao-proceedings.de/download/114/114_a1.pdf)

Li, W.; **Sandner, M.**; Gesierich, A.; Burke, J.: *Absolute optical surface measurement with deflectometry*. Proc. SPIE Interferometry XVI: Applications, eds.: C. Furlong, C. Gorecki, E. L. Novak. SPIE Bellingham (2012), S. 84940G-1-7

Sandner, M., Li, W.; v. Kopylow, C., Bergmann, R.B.: *Einsatz von Messsystemen auf Basis der Streifenprojektions- und Streifenreflexionstechnik zur Konturmessung und Oberflächen-charakterisierung*. Proc. XXV. Messtechnisches Symposium (2011), eds.: F. P. Léon, J. Beyerer. Shaker Verlag Aachen (2011), S. 163-174

Sandner, M., Li, W.; Bothe, T.; Burke, J.; v. Kopylow, C., Bergmann, R. B.: *Absolut-Abstandsreferenz für die Streifenreflexionstechnik zur Verringerung systematischer Messfehler*. 112. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für angewandte Optik (DGaO 2011), A2
(online: http://dgao-proceedings.de/download/112/112_a2.pdf)